立体原子像写真撮影のためのBL25二次元分析器の改良

中本 梓^a, 郭 方准^b, 松井 文彦^a, 藤門 倫明^a, 松下 智裕^b, 服部 賢^a, <u>大門 寛</u>^a ^a奈良先端科学技術大学院大学, ^b高輝度光科学研究センター

背景

物質はナノスケールになると、その構造と 性質が大きく異なってくるため、両者を同時 に測定して構造と物性の関係を解析すること が必要である。しかしながら、これまでナノ 構造体の結晶構造解析法はほとんど無かった といっても過言ではない。これまで行われて いた方法としては、透過電顕による原子構造 解析があるが、試料を薄く切り出すという作 業が必要であり、破壊的である。また、得ら れる像も原子配列を二次元的に投影したもの であり、立体的な配列はわからなかった。最 近開発された立体原子顕微鏡¹⁾(図1)は、ナ ノ薄膜の原子配列の立体写真が撮影できる新 しい手法であり、現在開発中のレンズと組み 合わせることにより、ナノ微粒子の原子配列 構造を解析できる唯一の手段として、ナノサ イエンスの基礎物性研究の強力なツールとな ることが期待される。既に、磁性ナノ薄膜の 解析に成功している2)。この手法は、新しく発 見された「光電子回折における円2色性 | 3)と いう性質を利用している。これは、光電子が 軌道角運動量をもっているために、前方散乱 ピークが左右に回転するという現象である。

BL25に設置されている二次元光電子分析器⁴⁾の図を、図2に示す。これは、初期の分

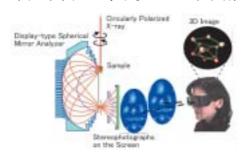


図1. 立体原子顕微鏡の概念図

析器50のエネルギー分解能を数倍に高めたも のである。障害リングの数を260程度と多く し、アルミの外球の内側にセラミックを蒸着 し、その内側に金薄膜を蒸着してある。しか しながら、この分析器は設置されてから5年 経過しており、最近は電極の接触やMCPの 放電など様々なトラブルが発生し、またCCD カメラが旧式で、光電子スペクトル測定に1 時間以上必要であったり、試料準備槽の真空 度が悪く、種々の装置が整備されていなくて 試料調整が難しく、良いデータが取れない状 況が続いていた。これまでに多くの修復を 行ってきたが、今回のビームタイムでは、新 しいCCDカメラシステムへの更新と、試料準 備層の整備、分析器制御電源の修理、を中心 に改良を行った。CCDカメラを更新したこと で、測定プログラムを新しく作成した(松下)。

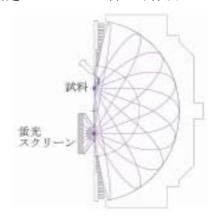


図2.BL25二次元光電子分析器

実験方法

実験は、BL25に設置されている二次元光電子分析器(図2)を用いて行った。励起光はヘリカルアンジュレータからの左右円偏光軟X線であり、エネルギーは1200eV程度を使用した。測定試料は、ナノ磁性薄膜のスピン

再配向転移に興味が持たれているCu(100) 面上に蒸着した数層のFe薄膜である。試料 準備槽でアルゴン衝撃と加熱によりCu(100) 清浄面を作成し、RHEEDで確認した。Feの 蒸着は坩堝の過熱により行った。膜圧は水晶 振動子型膜圧計で測定した。

実験結果

得られたFe 2p内殻領域の光電子スペクトルを図3に示す。運動エネルギー480eV付近にあるFe 2pの2本のピークの他に、510eV付近にO Augerピークが観測される。これは、試料準備槽の真空度がまだ不十分であることに起因している。図3のスペクトルは10分以内に取れている。これは、新しいCCDシステムによって、測定時間が従来の10分の一程度に短縮され、スペクトル測定の非効率性の問題が解消されたことを意味している。

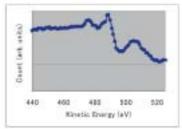


図3. Fe 2p内殻領域の光電子スペクトル

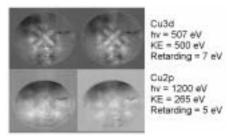


図 4. Cu 2p内殻およびCu 3dバンドからの 立体写真

図4には、測定したCu2p内殻およびCu3dバンドからの立体写真を示す。Cu2p内殻のみならず、Cu3dバンドからも立体写真が測定できている。通常はバンドを作っているような遍歴的な電子は角運動量が特定できないが、この場合は、円偏光の持つ角運動量が光電子に移るために軌道角運動量を持つようになったことが直視できている。

また、図4で運動エネルギーの違いによる 見え方の違いが明瞭に観測されている。運動 エネルギーが265eVの時には第2隣接原子ま でしか見えていないが、500eVの時には第3 隣接原子までが見えている。これは、運動エ ネルギーが高くなったために、光電子の平均 自由行程が伸びたことに起因している。

今後の展開と課題

現在の立体写真のパターンには、グリッドを何枚も通過する際のモアレや透過パターンが重畳されていて、原子像の形を悪くしている。グリッドをメッシュのものに変えることによって、10倍以上の明るさの増大とパターンの形の向上が期待されるため、改良を考える。また、励起光をサブミクロンに絞るミラーを導入したり、戦略的創造研究で行っているレンズシステムを備えることにより、微小領域の構造解析が可能なシステムへの改良を検討している。このような改良をすることにより、ナノ構造の原子配列が初めて測定可能になるものと期待される。

参考文献

- 1) H. Daimon, Phys. Rev. Lett. **86**, 2034 (2001).
- S. Okamoto, A. Nakamoto, S. Hayashi, K. Fukumoto, T. Nakatani, T. Matsushita, K. Hattori, H. Daimon, Trans. Magn. Soc. Japan 2, 228 (2002).
- H. Daimon, et al., Jpn. J. Appl. Phys., 32, L1480 (1993).
- 4) M.Kotsugi, et al. Nucl. Instrum. & Method in Physics Research A, **467**, 1493 (2001).
- [4] H. Daimon, Rev. Sci. Instrum., **59**, 545 (1988).

発表論文

[1] F. Z. Guo, T. Matsushita, F. Matsui, M. Fujikado, and H. Daimon, 9th International Conference on Electronic Spectroscopy and Structure, June 30 - July 4 2003, Uppsala University, Sweden. (口頭発表)